07

Лазеры на основе AlGaAsSb, излучающие в области 1.6 μ m

© Т.Н. Данилова, Б.Е. Журтанов, А.Н. Именков, М.А. Сиповская, Ю.П. Яковлев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 19 ноября 1998 г.

Изготовлены и исследованы лазеры на основе AlGaAsSb с разным содержанием Al в активной и ограничительных областях, излучающие в области $\sim 1.6\,\mu\text{m}$. Твердый раствор AlGaAsSb в активной области прямозонный с малым энергетическим расстоянием между прямозонным Γ минимумом и непрямозонным L минимумом ($\sim 56\,\text{meV}$) зоны проводимости ($\sim 56\,\text{meV}$). Спектры лазеров одномодовые с преимущественной продольной модой в пространственном распределении излучения. Лазеры работают при комнатной температуре в импульсном режиме.

1. Лазеры, излучающие в спектральной области вблизи $1.6 \,\mu m$, перспективны для диодно-лазерной спектроскопии, поскольку они работают при комнатной температуре, и в этой спектральной области лежат обертоны линий поглощения газов, вызывающих большой практический интерес, таких как метан (СН₄), углекислый газ (СО₂) и другие, фундаментальные полосы поглощения которых лежат в средней инфракрасной области $(3-4 \,\mu\text{m})$, где генерация при комнатной температуре не достигнута. Чтобы компенсировать слабое поглощение света на обертонах по сравнению с фундаментальным поглощением, обычно используются многопроходные кюветы, содержащие исследуемый газ [1]. На этом принципе создан, например, портативный анализатор метана с использованием лазера на основе твердого раствора InGaAsP для измерений в открытой атмосфере [2]. В настощее время созданы приборы с очень высоким спектральным разрешением с использованием диодных лазеров на основе гетероструктур InGaAsP/InP для чувствительного оптического детектирования и дифференцирования близко расположенных обертона $2\nu_3$ линии поглощения CH_4 и $6\nu_2 + \nu_3$ комбинационной линии CO_2 в спектральной области $1.6 \,\mu m$ [3,4].

3*

Нами предпринята попытка создания и исследования диодных лазеров на основе другого полупроводникового твердого раствора, AlGaAsSb, работающих в спектральной области $\sim 1.6\,\mu \mathrm{m}$. Лазеры содержат гетероструктуру с активной и широкозонными областями, состоящими из того же твердого раствора AlGaAsSb, но с разным содержанием Al. В твердом растворе AlGaAsSb при прямозонных составах энергетическое расстояние между прямозонным Γ минимумом и непрямозонным L минимумом меньше $100\,\mathrm{meV}$. Представляет интерес определить, возможна ли генерация в лазерах с активной областью, содержащей такой полупроводниковый материал.

2. Исследуемые лазерные структуры изготавливались методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) на подложке n-GaSb(100), легированной Те до концентрации свободных электронов $(8-9) \cdot 10^{17} \, \text{cm}^{-3}$. Схема расположения слоев в лазерной структуре представлена на рис. 1, а. Все выращенные слои изопериодны с подложкой. Величина рассогласования периодов подложки и узкозонных слоев $\Delta a/a = (8-9) \cdot 10^{-4}$, а подложки и широкозонных слоев $\Delta a/a \sim 10^{-3}$. Узкозонный слой активной области состава $Al_{0.05}Ga_{0.95}As_{0.044}Sb_{0.956}$ легировался Те до концентрации свободных электронов $(3-5) \cdot 10^{17} \, \mathrm{cm}^{-3}$. Толщина этого узкозонного слоя $0.5\,\mu\mathrm{m}$. Широкозонные слои выращивались с большим содержанием A1 и имели состав Al_{0.34}Ga_{0.66}As_{0.44}Sb_{0.956}. N-широкозонный слой легирован Те до концентрации свободных электронов $(3-5) \cdot 10^{17} \, \text{cm}^{-3}$ и *P*-широкозонный слой легирован Ge до концентрации свободных дырок $\sim 7 \cdot 10^{17} \, \mathrm{cm}^{-3}$. Приконтактный узкозонный Р-слой такого же состава, как слой активной области, легировался до концентрации дырок $\sim 1 \cdot 10^{19} \, \mathrm{cm}^{-3}$. Толщина широкозонных слоев $\sim 2.5 \, \mu {\rm m}$, а приконтактного высоколегированного слоя $\sim 1.5 \, \mu {\rm m}$.

Изменение ширины запрещенной зоны (E_g) по толщине структуры при комнатной температуре представлено на рис. 1, b. В активной области E_g соответствует длине волны излучения $\lambda \sim 1.6~\mu \mathrm{m}$ и составляет $\sim 0.775~\mathrm{eV}$. В широкозонных ограничительных областях E_g имеет величину $\sim 1.0~\mathrm{eV}$. Приконтактный сильнолегированный P-слой имеет величину E_g примерно такую же, как активная область. Твердый раствор $\mathrm{Al}_x\mathrm{Ga}_{1-x}\mathrm{AsSb}$ в активной области (x=0.05) прямозонный, а в широкозонных областях (x=0.34) непрямозонный, поскольку переход от абсолютного Γ -минимума к абсолютному L-минимуму происходит при x=0.25 [5–6]. Однако в активной области непрямозонный L-минимум близко расположен к прямозонному Γ -минимуму, на энергетическом

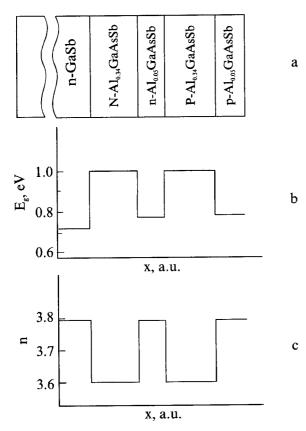


Рис. 1. Схема расположения слоев в лазерной структуре (a), послойное распределение ширины запрещенной зоны E_g (b), послойное распределение показателя преломления n (c).

расстоянии $\sim 56\,\mathrm{meV}$. Гетерограницы между активной областью и широкозонными ограничительными областями являются гетеропереходами *I*-типа с разрывом в зоне проводимости $E_c\sim 120-150\,\mathrm{meV}$ и с разрывом в валентной зоне $E_v\sim 150-170\,\mathrm{meV}$.

Изменение показателя преломления n по толщине структуры представлено на рис. 1, c. Значения приведенных величин расчетные.

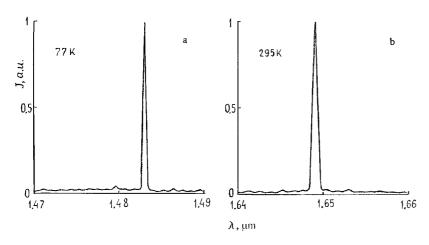


Рис. 2. Спектры излучения лазера (E-174 N 14) при 77 K (a) и при комнатной температуре (b).

Показатель преломления в активной области имеет величину, близкую к его величине для GaSb, и равен примерно 3.79. Показатель преломления в широкозонной ограничительной области $Al_{0.34}Ga_{0.66}As_{0.044}Sb_{0.956}$ составляет величину ~ 3.6 . Таким образом, разность показателей преломления между активной и широкозонной областями $\Delta n \sim 0.19$.

Из лазерной эпитаксиальной структуры методом фотолитографии изготавливались мезаполоски шириной $\sim 10\,\mu\mathrm{m}$. Резонаторы Фабри–Перо лазеров длиной $200–250\,\mu\mathrm{m}$ образовывались скалыванием.

У исследуемых лазеров измерялись спектры излучения, диаграммы распределения излучения в дальнем поле и вольт-амперные характеристики.

Спектры излучения исследуемых лазеров измерялись при 77 К и при комнатной температуре. В качестве диспергирующего прибора использовался монохроматор МДР-2. Фотоприемником служил фотодиод на основе GaInAsSb [7]. При 77 К измерения проводились при питании лазеров импульсами тока типа меандр с частотой следования $400\,\mathrm{Hz}$. При комнатной температуре лазеры питались импульсами тока длительностью $\tau=500\,\mathrm{ns}$ при частоте следования $30\,\mathrm{kHz}$.

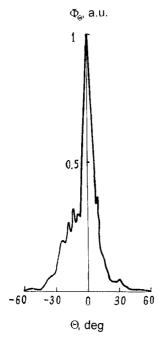


Рис. 3. Распределение в дальней зоне интенсивности излучения Φ в зависимости от угла регистрации излучения Θ лазера E-174 N 14.

3. Спектр излучения одного из исследуемых лазеров $(E\text{-}174\ \text{N}\ 14)$ представлен на рис. 2 при 77 K (рис. 2, a) при токе 40 mA и при комнатной температуре (рис. 2, b) при токе 880 mA. Лазер имеет пороговый ток 27.5 mA при 77 K и \sim 800 mA при комнатной температуре. Спектры излучения лазеров одномодовые. Смещение длины волны с температурой от 77 K до комнатной происходит со скоростью \sim 7.6 Å/deg.

На рис. 3 приведено пространственное распределение излучения лазера в плоскости p-n-перехода в дальнем поле при токе $30\,\mathrm{mA}$ и температуре $77\,\mathrm{K}$. Диаграмма направленности имеет преимущественную продольную моду с шириной на половине максимума интенсивности $10.8\,\mathrm{rpa}$ градуса. Боковые максимумы, вероятно, соответствуют поперечным

модам, их общая интенсивность приблизительно в четыре раза меньше, чем интенсивность продольной моды. Интенсивность поперечных мод уменьшается с ростом номера моды. В плоскости, перпендикулярной p-n-переходу, ширина диаграммы направленности на половине высоты интенсивности составляет 40-50 градусов.

Из измерений вольт-амперных характеристик лазеров при комнатной температуре получено, что остаточное сопротивление лазерных структур имеет величину $\sim 28\,\Omega.$

4. Обсудим полученные результаты.

Основной результат этой работы состоит в том, что получена генерация в лазере с активной областью из прямозонного материала, в котором непрямозонный L-минимум расположен близко к прямозонному Γ -минимуму, на энергетическом расстоянии $\sim 56\,\mathrm{meV}$. Оценки показывают, что в условиях генерации в таком материале в побочном непрямозонном минимуме зоны проводимости концентрация электронов на порядок больше, чем в главном прямозонном минимуме.

Спектры полученных лазеров одномодовые с пространственным распределением преимущественно в продольной моде. Сдвиг длины волны когерентного излучения при изменении температуры от 77 К до комнатной происходит со скоростью примерно в два раза меньшей, чем то изменение, которое соответствовало бы изменению с температурой в том же температурном интервале ширины запрещенной зоны в активной области лазера.

Присутствие поперечных мод в пространственном распределении излучения лазера, вероятно, определяется недостаточно узкой шириной полоска для длины волны излучения $1.6\,\mu m$. Это может быть учтено при дальнейшей работе.

Из-за того, что ограничительные слои структуры непрямозонные, лазеры обладают высоким последовательным сопротивление (28 Ω), которое, однако, можно уменьшить за счет увеличения легирования этих слоев.

Работа частично поддержана контрактом INCO-Copernicus N 1C15–CT97–0802 (DG12–CDPF) и частично грантом Министерства науки РФ по программе "Оптика и лазерная физика".

Список литературы

- [1] Chernin S.M., Barskaya E.G. // Appl. Opt. 1991. V. 30. P. 51.
- [2] Beresin A., Chernin S., Ershov O., Kutnyak V., Nadezhdinskii A. // 2nd International Conference on Tunable Diode Laser Spectroscopy. 1998. Moscow. Abstracts of papers. P. 33.
- [3] Weldon V., Phelan P., Hegarty J. // Electron. Lett. 1992. V. 28 (22). P. 2098–2099.
- [4] Weldon V., Phelan P., Hegarty J. // Electron. Lett. 1993. V. 29. P. 560-561.
- [5] Mead C.A., Spitzer W.G. // Phys. Rev. Lett. 1963. V. 11. P. 358.
- [6] Акимов Ю.А., Буров А.А., Загаринский Е.А., Крюкова И.В., Петрушенко Ю.В., Степанов Б.М. // Квант. электр. 1975. Т. 2. С. 68.
- [7] Андреев И.А., Баранов А.Н., Афраилов М.А., Данильченко В.Г., Михайлова М.П., Яковлев Ю.П. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12 (21). С. 1311–1315.